# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, Please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06295464 A

(43) Date of publication of application: 21.10.94

(51) Int. CI

G11B 7/135

(21) Application number: 05105896

(22) Date of filing: 09.04.93

(71) Applicant:

RICOH CO LTD

(72) Inventor:

**GOTO HIROSHI** 

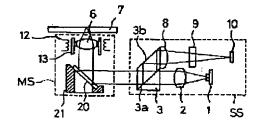
## (54) OPTICAL PICKUP DEVICE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To make the objective lens actuator of an optical pickup device light in weight and easily make the device thin.

CONSTITUTION: A linearly polarized laser beam outputted from a fixed optical system SS is reflected by the reflection type 1/4 wavelength plate 20 of a moving optical system MS, converted to a circularly polarized beam and introduced to an objective lens 6. Consequently, since the laser beam from the stationary optical system SS is made incident on the objective lens 6 and the laser beam is converted from a linearly polarized beam to the circularly polarized beam, a number of the optical parts composing the moving optical system MS is reduced and the size of the moving optical system MS in the direction of its thickness is decreased compared with the conventional device. Consequently, the cost of the device is reduced and the optical pickup device is easily made thin.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO



## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出顧公開番号

## 特開平6-295464

(43)公開日 平成6年(1994)10月21日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 7/135

Z 7247-5D

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 5 頁)

(21)出願番号

特顧平5-105896

(22)出願日

平成5年(1993)4月9日

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 後藤 博志

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

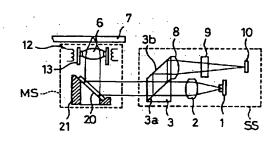
(74)代理人 弁理士 紋田 誠

## (54)【発明の名称】 光ピックアップ装置

## (57)【要約】

【目的】 光ピックアップ装置の対物レンズアクチュエ ータの重量を軽減し、薄型化を容易にする。

【構成】 固定光学系SSから出力された直線偏光のレ ーザ光は、移動光学系MSの反射型(1/4)波長板2 0により反射されるとともに、円偏光に変換され、対物 レンズ6に導かれる。したがって、反射型(1/4)波 長板20を用いて、固定光学系SSからのレーザ光を対 物レンズ6に入射するとともに、レーザ光を直線偏光か ら円偏光に変換しているので、従来装置に比べて移動光 学系MSを構成する光学部品の点数を削減することがで き、また、移動光学系MSの厚さ方向の寸法を低減する ことができる。したがって、装置コストを低減できると ともに、光ピックアップ装置の薄型化を容易にすること ができる。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体レーザ素子から出力されるレーザ 光を用いて光記録媒体にデータを記録/再生する光ピッ クアップ装置において、

光源光を偏向して光記録媒体にレーザ光を集束する対物 レンズに入射させるとともに直線偏光を円偏光に変換す る波長板を備えたことを特徴とする光ピックアップ装 置。

【請求項2】 前記波長板は、前記対物レンズの光軸に 対して略45度傾斜されて配設されていることを特徴と 10 する請求項1記載の光ピックアップ装置。

【請求項3】 前記波長板のレーザ光の反射面には増反 射膜が形成され、この増反射膜の位相差は、20度以下 に設定されていることを特徴とする請求項1または請求 項2記載の光ピックアップ装置。

【請求項4】 前記波長板のレーザ光の入射面には反射 防止膜が形成されるとともに、その反射面には増反射膜 が形成され、上記入射面での反射光と、上記入射面で屈 折し上記反射面で反射し再度上記入射面で屈折して射出 される光の位相差が、(90±20)度に設定されてい 20 ることを特徴とする請求項1または請求項2記載の光ピ ックアップ装置。

【請求項5】 前記波長板が、1/7波長板であることを特徴とする請求項1または請求項2または請求項3または請求項4記載の光ピックアップ装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体レーザ素子から 出力されるレーザ光を用いて光記録媒体にデータを記録 /再生する光ピックアップ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、光ディスク駆動装置などで、光 記録媒体にデータを記録/再生するために用いられてい る光ピックアップ装置の従来例を図8に示す。

【0003】同図において、光ピックアップ装置は、光源光学系および検出光学系などを備えた固定光学系SSと、対物レンズおよび偏向プリズムなどを備えた移動光学系MSに分割されている。

【0004】半導体レーザ素子1から出力されたレーザ 光は、コリメートレンズ2によって平行なレーザビーム 40 に変換され、偏光ビームスプリッタ3の分割面3aを透 過した後に、移動光学系MSの偏向プリズム4の反射面 4aで反射され、1/4波長板5を透過して円偏光の光 に変換された後に、対物レンズ6に入射され、光ディス ク7に結像される。

【0005】また、光ディスク7からの反射光(以下、信号光という)は、対物レンズ6を通過したのちに、1 /4波長板5を通過して、入射光と方位が直交する直線 偏光に変換される。したがって、偏向プリズム4の反射 面4aを反射した信号光は、偏光ビームスプリッタ3の 50

分割面3 a に対して S 偏光となるので、この分割面3 a 射される。

【0006】この分割面3aで反射された信号光は、偏 光ビームスプリッタ3の反射面3bで 反射されて偏光 ビームスプリッタ3より出射され、集束レンズ8によっ て集束された状態で、シリンドリカルレンズ9を通過 し、受光面(図示略)が4分割された受光素子10に集 束される。

【0007】この受光素子10の4つの受光面から得られる受光信号を用いて、周知の非点収差法によるフォーカシング誤差信号、トラッキング誤差信号、および、再生信号などが形成される。

【0008】また、保持部材11は、偏向プリズム4を移動光学系MSの筐体に取りつけるためのものであり、対物レンズ移動機構12は、対物レンズ6をその光軸方向およびトラッキング方向に移動するためのものである。また、1/4波長板5は、対物レンズ移動機構12において、対物レンズ6を保持するための対物レンズホルダ13の下面に取り付けられている。また、光ディスク74、図示しない回転機構に着脱自在に取り付けられている。

【0009】このようにして、1/4波長板5を偏向プリズム4と対物レンズ6との間に位置させているため、偏向プリズム4の反射面4aの位相差が原因となる戻り光が半導体レーザ素子1に入射されることを防止できる。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来装置では、次のような不都合を生じていた。

【0011】すなわち、対物レンズ移動機構12の対物レンズホルダ13に1/4波長板5を取り付けているため、対物レンズ移動機構12が駆動する対象(可動部)の重量が増大するという不都合を生じる。また、移動光学系MSの厚さ方向の寸法を低減して薄型化するときの障害となる。

【0012】本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、対物レンズ移動機構の可動部の重量を低減できるとともに、薄型化が容易な光ピックアップ装置を提供することを目的としている。

[0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、半導体レーザ素子から出力されるレーザ光を用いて光記録媒体にデータを記録/再生する光ピックアップ装置において、光源光を偏向して光記録媒体にレーザ光を集束する対物レンズに入射させるとともに直線偏光を円偏光に変換する波長板を備えたものである。また、前記波長板は、前記対物レンズの光軸に対して略45度傾斜して配設するとよい。また、前記波長板のレーザ光の反射面には増反射膜を形成し、この増反射膜の位相差を20度以下に設定するとよい。また、前記波長板のレーザ光の入射面には反

射防止膜を形成するとともに、その反射面には増反射膜 を形成し、上記入射面での反射光と、上記入射面で屈折 し上記反射面で反射し再度上記入射面で屈折して射出さ れる光の位相差を、(90±20)度に設定するとよ い。また、前記波長板として、1/7波長板を用いるこ とができる。

## [0014]

【作用】したがって、波長板を用いて、光源光を対物レ ンズに偏向するとともに、光源光の偏光を直線偏光から 円偏光に変換するようにしているので、従来必要であっ 10 た偏向プリズムのような光学素子を省略することができ るので、装置の薄型化が容易になる。また、従来のよう に、1/4波長板を対物レンズホルダに取りつける必要 がないので、対物レンズ移動機構の可動部の重量が増大 するような事態を回避することができる。

## [0015]

【実施例】以下、添付図面を参照しながら、本発明の実 施例を詳細に説明する。

【0016】図1は、本発明の一実施例にかかる光ピッ クアップ装置の光学系の要部を示している。なお、同図 20 において、図8と同一部分および相当する部分には、同 一符号を付している。

【0017】同図において、固定光学系SSから出力さ れた直線偏光のレーザ光は、移動光学系MSの反射型 (1/4)波長板20により反射されるとともに、円偏 光に変換され、対物レンズ6に導かれる。また、反射型 (1/4) 波長板20は、取り付け部材21を介して、 移動光学系MSの筐体に取り付けられている。

【0018】このようにして、本実施例では、反射型 (1/4)波長板20を用いて、固定光学系SSからの 30 レーザ光を対物レンズ6に入射するとともに、レーザ光\*  $sin\theta 1=No \cdot sin\theta 2$ 

【0025】ここで、水晶の常光線に対する屈折率No は、No=1. 53859 (波長λ=790 (nm) の とき) なので、 $\theta 2 = 27$ . 36° になる。

【0026】図5 (a) に、水晶の屈折率楕円体RGを 示す。

【0027】通常、反射型(1/4)波長板20は、水 晶を、結晶軸zを含む面でカットして形成しており、こ の場合、反射型(1/4)波長板20に直角に光を入射 40 率が小さくなる方向に変化する。 すると、同図(b)に示したように、常光線屈折率がN oでかつ異常光線屈折率がNeとなる。

【0028】そして、本実施例のように、反射型(1/ 4) 波長板20に対して、角度φで光を入射すると、こ の場合、水晶を結晶軸zに対してφの角度でカットして※

 $(1/Ne') **2 = (sin (\theta 2)/No) **2$ 

 $+ (\cos (\theta 2) / Ne) **2$ (II)

[0031]

【0032】 ここで、(x) \*\*mは、xのm乗をあら わす演算子である。

【0033】また、反射型 (1/4) 波長板 20 の板厚 50 差  $\Delta$   $(\theta2)$  は、次式 (III) のようになる。

\*を直線偏光から円偏光に変換しているので、従来装置に 比べて移動光学系MSを構成する光学部品の点数を削減 することができ、また、移動光学系MSの厚さ方向の寸 法を低減することができる。 また、 図 8 に示した従<del>来</del>装 置のように、対物レンズホルダ13に波長板を取り付け ていないので、対物レンズ移動機構12の可動部の重量 が増大することを防止することができる。したがって、 装置コストを低減できるとともに、光ピックアップ装置 の薄型化を容易にすることができる。

【0019】図2は、反射型(1/4)波長板20での 光の屈折および反射の状況を示している。

【0020】固定光学系SSからの入射光LIは、反射 型(1/4)波長板20の面20 aから入射され、この 面20aで屈折され、反射型(1/4)波長板20の内 部を通過し、反射型(1/4)波長板20の反対の面2 ・O b で反射され、反射型(1/4)波長板20の内部を 通過し、面20aで屈折されて出射光LOとして出射さ れる。この出射光LOは、入射光LIと90度の角度を なす。

【0021】また、図3に示すように、反射型(1/ 4) 波長板20の光学軸 (f軸) 20pは、x方向およ びy方向と45度の方向に設定されているため、x方向 の直線偏光は、円偏光に変換される。

【0022】さて、図4に示すように、反射型(1/ 4) 波長板20への入射光LIの面20aでの入射点を A、面20bでの反射点をB、面20aからの出射光L Oの出射点をCとすると、この場合、入射光LIは、点 Aに入射角 $\theta$ 1=45°で入射して屈折する。

【0023】このときの屈折角を82とすると、次式 (I)の関係が成り立つ。

[0024]

(I)

※形成した反射型(1/4)波長板20に対して光を直角 に入射したこととと等価となり、したがって、同図

(c) に示したように、この場合、常光線屈折率がNo でかつ異常光線屈折率がNe'となる。ここで、Ne' <Neである。

【0029】このようにして、反射型(1/4)波長板 20に光を斜め方向から入射したとき、異常光線の屈折

【0030】さて、この場合、反射型(1/4)波長板 20へ光を入射したときの屈折角がθ2なので、次式 (II)の関係が成立する。

を d、光が光路 ABC (図4参照)を進むときの光路長 を t とすると、この反射型(1/4)波長板20の位相

5

[0034]

 $\Delta (\theta 2) = 2\pi \cdot (Ne' - No) \cdot t / \lambda$ (III)

【0035】ここで、板厚dと光路長tとの間には、次 \* [0036] 式(IV)なる関係が成り立つ。

 $t = 2 d/cos(\theta 2)$ 

(IV)

【0037】一方、反射型(1/4)波長板20に光を ※うになる。

垂直入射したときの位相差∆(0)は、次式(V)のよ※ [0038]

> $\Delta (0) = 2\pi \cdot (Ne-No) \cdot d/\lambda$ (V)

【0039】したがって、式(III),(IV),

★ [0040]

(V) より、次式 (VI) が得られる。

**★**10

 $\Delta (0) = (\Delta (\theta 2) \cdot (Ne-No))$ 

 $/ (Ne' - No) \cdot cos (\theta 2) / 2$  (VI)

【0041】このとき、

 $\Delta (\theta 2) = 90^{\circ}$ 

 $No=1.53859 (\lambda = 790 (nm))$ 

 $Ne = 1.54749 (\lambda = 790 (nm))$ 

 $\theta 2 = 27.36^{\circ}$ 

なので、式(VI)より、

Ne' = 1.545597

 $\Delta$  (0) = 50. 76° =  $\lambda$ /7. 09

となる。すなわち、反射型(1/4)波長板20として は、1/7波長板を用いることができる。

【0042】ところで、図6 (a) に示したように、反 射型(1/4)波長板20の面20 aで入射光LIの一 部が反射し、その反射光してが出射光し〇と干渉すると 期待した光学特性が得られないため、同図(b)に示し たように、面20aには、誘電体多層膜による反射防止 膜22を形成するとよい。これにより、反射型(1/ 4) 波長板20の面20aでの反射率を0.5%程度に 低減することができる。また、面20bで光を反射する 30 ために、面20 bには、誘電体多層膜による増反射膜2 3を形成するとよい。これにより、面20 bでの反射率 を99%程度にすることができる。

【0043】また、この増反射膜23に位相差が生じて いると、半導体レーザ素子1への戻り光が生じ、位相差 と戻り光との関係は、図7に示したようになる。通常の 使用では、戻り光が6%程度あっても差し支えない場合 があるので、増反射膜23の位相差を(土)20°以下 に抑制するとよい。なお、この位相差は、小さくするこ とが望ましく、例えば、±5°程度に抑えることが好ま 40 しい。

【0044】ところで、上述した実施例では、非点収差 法を用いた光ピックアップ装置に本発明を適用した場合 について説明したが、それ以外のフォーカシング誤差検 出方法を用いる光ピックアップ装置についても本発明を 同様にして適用することができる。

[0045]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 波長板を用いて、光源光を対物レンズに偏向するととも に、光源光の偏光を直線偏光から円偏光に変換するよう にしているので、従来必要であった偏向プリズムのよう 20 な光学素子を省略することができるので、装置の薄型化 が容易になる。また、従来のように、1/4波長板を対 物レンズホルダに取りつける必要がないので、対物レン ズ移動機構の可動部の重量が増大するような事態を回避 することができるという効果を得る。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例にかかる光ピックアップ装置 の光学系を示した概略構成図。

【図2】反射型(1/4)波長板の光の通過について説 明するための概略図。

【図3】反射型(1/4)波長板の光学軸について説明 するための概略図。

【図4】反射型(1/4)波長板を通過する光路につい て説明するための概略図。

【図5】反射型(1/4)波長板の常光線屈折率と異常 光線屈折率を説明するための概略図。

【図6】反射型(1/4)波長板の面に形成する反射防 止膜および増反射膜について説明するための概略図。

【図7】増反射膜の位相差と戻り光との関係を示したグ ラフ図。

【図8】光ピックアップ装置の従来例を示した概略図。 【符号の説明】

- 20 反射型(1/4)波長板
- 22 反射防止膜
- 23 增反射膜

